

Title (en)
VACUUM PUMP AND METHOD FOR MONITORING A VACUUM PUMP

Title (de)
VAKUUMPUMPE UND VERFAHREN ZUM ÜBERWACHEN EINER VAKUUMPUMPE

Title (fr)
POMPE À VIDE ET PROCÉDÉ DE SURVEILLANCE D'UNE POMPE À VIDE

Publication
EP 3736447 A1 20201111 (DE)

Application
EP 20170014 A 20200417

Priority
EP 20170014 A 20200417

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vakuumpumpe oder ein zumindest eine Vakuumpumpe umfassendes Vakuumsystem, wobei der Vakuumpumpe eine Inertialmesseinheit zugeordnet ist, die zumindest einen Inertialsensor umfasst, der dazu ausgebildet ist, Bewegungen der Vakuumpumpe und/oder die Orientierung der Vakuumpumpe zu erfassen und diesbezügliche Messdaten und/oder durch Auswerten dieser Messdaten erhaltene Informationen bereitzustellen.

IPC 8 full level
F04D 27/00 (2006.01); **F04D 19/04** (2006.01)

CPC (source: EP)
F04D 19/04 (2013.01); **F04D 19/042** (2013.01); **F04D 27/001** (2013.01); **F05B 2270/334** (2013.01); **F05B 2270/807** (2013.01); **F05D 2260/80** (2013.01); **F05D 2260/82** (2013.01)

Citation (search report)

- [XY] DE 202015003927 U1 20150713 - OERLIKON LEYBOLD VACUUM GMBH [DE]
- [XI] WO 2017216514 A1 20171221 - EDWARDS LTD [GB]
- [XYI] US 2019383296 A1 20191219 - HASHIMOTO TOSHIFUMI [JP], et al
- [XI] JP 2007270829 A 20071018 - SHIMADZU CORP
- [E] EP 3686432 A1 20200729 - PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG [DE]

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3736447 A1 20201111

DOCDB simple family (application)
EP 20170014 A 20200417